

請求の範囲

- [請求項1] 基板と、
前記基板に形成された、試料が移動するための流路と、
前記流路の両端に設けられた一对の空気連通口と、
前記流路における前記一对の空気連通口の間に形成された、試料にサーマルサイクルを与えるためのサーマルサイクル領域と、
を備え、
前記流路は、前記サーマルサイクル領域と少なくとも一方の前記空気連通口との間に、複数の分岐流路を備えることを特徴とする反応処理容器。
- [請求項2] 前記サーマルサイクル領域は、第1温度に維持される第1温度領域と、前記第1温度よりも高い第2温度に維持される第2温度領域と、を含み、
前記複数の分岐流路は、前記第2温度領域と該第2温度領域側に位置する空気連通口との間に配置されることを特徴とする請求項1に記載の反応処理容器。
- [請求項3] 前記サーマルサイクル領域の流路と前記複数の分岐流路との分岐部は、前記第2温度領域の近傍に配置されることを特徴とする請求項2に記載の反応処理容器。
- [請求項4] 前記複数の分岐流路のうち少なくとも一つの分岐流路は、前記第2温度領域の近傍を通るように配置されることを特徴とする請求項3に記載の反応処理容器。
- [請求項5] 前記複数の分岐流路は、それぞれ屈曲部を備え、
前記複数の分岐流路のうち少なくとも一つの分岐流路の屈曲部は、他の分岐流路の屈曲部よりも大きい曲率半径で屈曲していることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の反応処理容器。
- [請求項6] 請求項1から5のいずれかに記載の反応処理容器と、
前記サーマルサイクル領域の温度を調節するための温度制御手段と

、
試料を前記流路内で移動および停止させる送液手段と、
を備えることを特徴とする反応処理装置。